

## ②大容量イオン液体可変キャパシタ技術のエナジーハーベスタ応用

|                                      | H27<br>4,5,6月                                                         | H27<br>7月 | H27<br>8月 | H27<br>9月 | H27<br>10月 | H27<br>11月 | H27<br>12月 | H28<br>1月 | H28<br>2月 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ②-(1)<br>イオン液体のエナ<br>ジーハーベスタ応用<br>検討 | イオン液体の機械、電気特性評価<br>濡れ性と電気二重層形成状態の評価<br>当初計画<br>実施状況 <b>完了</b>         |           |           |           |            |            |            |           |           |
| ②-(2)<br>イオン液体のゲル化<br>検討             | ゲル化したイオン液体の機械、<br>電気特性評価<br>当初計画<br>実施状況 <b>評価中、10/5に結果報告予定</b>       |           |           |           |            |            |            |           |           |
| ②-(3)<br>ゲル化イオン液体の<br>イオン固定方法検討      | イオン液体のイオン固定検討<br>当初計画<br>実施状況 <b>評価中、10/5に結果報告予定</b><br><b>H28へ継続</b> |           |           |           |            |            |            |           |           |

## ③高効率エネルギーハーベスタの開発

|                            | H27<br>4,5,6月                                                                                                              | H27<br>7月 | H27<br>8月 | H27<br>9月 | H27<br>10月 | H27<br>11月 | H27<br>12月 | H28<br>1月 | H28<br>2月 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ③-(1)<br>エネルギーハーベスタ<br>の設計 | <p>・等価回路モデルの確立<br/>・二次試作品の実験検証</p> <p>エネルギーハーベスタの最適設計手法<br/>の理論的構築</p> <p>当初計画</p> <p>実施状況</p> <p>二次試作品製作中、10/5に結果報告予定</p> |           |           |           |            |            |            |           |           |
| ③-(2)<br>エネルギーハーベスタ<br>の製作 | <p>高アスペクト比シリコン構造の設計・製作プロセス確立</p> <p>当初計画</p> <p>DRIE装置が9月より稼働予定</p> <p>H28へ継続</p>                                          |           |           |           |            |            |            |           |           |

## ②大容量イオン液体可変キャパシタ技術のエネルギーハーベスタ応用

|                               | H27<br>4,5,6月 | H27<br>7月 | H27<br>8月 | H27<br>9月 | H27<br>10月 | H27<br>11月 | H27<br>12月 | H28<br>1月 | H28<br>2月 |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ②-(1)<br>イオン液体のエネルギーハーベスタ応用検討 |               |           |           |           |            |            |            |           |           |
| ②-(2)<br>イオン液体のゲル化検討          |               |           |           |           |            |            |            |           |           |
| ②-(3)<br>ゲル化イオン液体のイオン固定方法検討   |               |           |           |           |            |            |            |           |           |

・FLAT ITO膜付きガラス(¥90,000/400,000): 消耗品  
・UV硬化装置(¥127,400/400,000): 消耗品  
・測定装置(¥800,000/1,000,000): 機械装置

## ③高効率エネルギーハーベスタの開発

|                        | H27<br>4,5,6月 | H27<br>7月 | H27<br>8月 | H27<br>9月 | H27<br>10月 | H27<br>11月 | H27<br>12月 | H28<br>1月 | H28<br>2月 |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ③-(1)<br>エネルギーハーベスタの設計 |               |           |           |           |            |            |            |           |           |
| ③-(2)<br>エネルギーハーベスタの製作 |               |           |           |           |            |            |            |           |           |

・Crマスク製作(¥367,000/1,600,000): 外注費  
・シリコン深掘加工装置一式のリース(¥22,888,000/23,388,000): 諸経費